05;07;12

## Теплофизические и оптические свойства микросистем с луночным рельефом на основе карбида кремния

© В.А. Карачинов, Д.В. Карачинов, М.В. Казакова

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, 173003 Великий Новгород, Россия e-mail: mkazakova@hotbox.rue-mail

(Поступило в Редакцию 28 октября 2011 г.)

Приведены результаты моделирования и экспериментальных исследований оптических, теплофизических и гидродинамических характеристик SiC-пирометрической микросистемы с луночным микрорельефом.

## Введение

Карбиды, силициды и нитриды ряда металлов и полупроводников, способные выдерживать на воздухе тепловые нагрузки свыше 1000°С, представляют традиционный интерес для решения задач, связанных с проведением исследований в области газовой динамики, а также при диагностике различных технических систем [1]. Среди них особую актуальность для создания измерительных микросистем пирометрии газовых потоков и высокотемпературной анемометрии, содержащих поверхности нагрева с развитой морфологией, приобретает карбид кремния, который в силу своих уникальных физико-химических свойств нашел в настоящее время широкое применение в оптоэлектронике, приборах и устройствах высокотемпературной электроники [2–5].

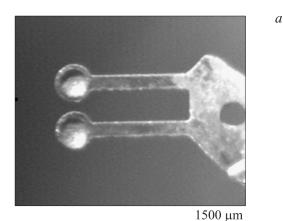
Известно, что применение поверхности нагрева с шероховатостью в виде выступов или лунок различного профиля способствует интенсификации процесса теплопередачи в таких объектах как пластины, стержни, трубы [6,7]. С точки зрения гидродинамики это связано с тем, что наличие развитого рельефа поверхности, который создает возмущения, как правило, приводит к более быстрому развитию турбулентности [8,9]. В то же время, как показано в ряде работ, в условиях ламинарного характера движения газа вдоль шероховатой поверхности не происходит отрыва пограничного слоя и сохраняется свойство его локализации [10]. Следует подчеркнуть, что отмеченное своеобразное обтекание шероховатых тел существенно сказывается и на их теплообмене с нагретыми газовыми потоками.

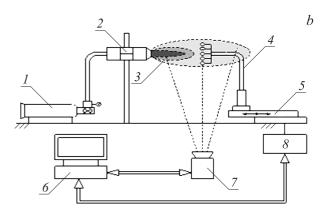
Для изделий из карбида кремния на уровне микроразмеров эти вопросы изучены недостаточно. Поэтому в настоящей работе приводятся результаты моделирования и экспериментальных исследований теплофизических и оптических характеристик микросистем с луночным рельефом на основе карбида кремния.

### Методика исследований

Пирометрические микросистемы в виде зондов толщиной  $\sim 450 \, \mu \mathrm{m}$  и глубиной лунки  $\sim 300 \, \mu \mathrm{m}$  (рис. 1, *a*),

изготавливались из монокристаллического карбида кремния по методам эрозионного профилирования в жидком диэлектрике [11]. Использовались кристаллы 6H-SiC < N >, полученные с помощью методов Лели и "ЛЭТИ" с концентрацией нескомпенсированных доноров  $N_d-N_a=(1-3)\cdot 10^{18}~{\rm cm}^{-3}$  без видимых макродефектов. После операции резки проводились химическое травление структур в расплаве КОН при температуре  $T=600^{\circ}{\rm C}$  и последующая установка их на цилиндриче-





**Рис. 1.** Пирометрическая микросистема (a) и структурная схема измерительного стенда (b): I — источник газа (пропан), 2 — форсунка, 3 — факел, 4 — пирометрический зонд, 5 — позиционер, 6 — ПЭВМ с ППП "Парус", 7 — телевизионный пирометр, 8 — контроллер позиционера.

9 129

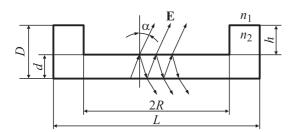
ский держатель из поликристаллического SiC (силитовый стержень).

Экспериментальная установка (рис. 1, b) содержала: систему газовой форсунки (пропан) с измерителем расхода (скорости) газа в магистрали типа РМ-А-0.0631; позиционер для ввода зонда в заданную область исследуемого газового потока (точность установки  $\pm 0.5 \, \text{mm}$ ); эталонный термоприемник (термопара ТХА с предельно допустимой температурой 1300°С); монохроматический телевизионный пирометр яркостного типа (система "Пиротел-К",  $\lambda = 0.6 - 72 \,\mu\text{m}$  [12]) и ПЭВМ с программным обеспечением "Парус". Для количественной оценки коэффициента излучения SiC в свете длины волны  $\lambda = 0.65 \, \mu \text{m}$  использовалась известная методика, реализующая принцип непосредственного сравнения яркостей кристалла SiC и излучателя сравнения, значение коэффициента излучения которого известно (метод пятна) [13]. В экспериментах использовался платиновый излучатель сравнения, изготовленный термовакуумным напылением слоя платины толщиной  $\sim 0.2\,\mu\mathrm{m}$  на гладкую протравленную грань (0001)С пластинчатого монокристалла 6H-SiC.

## **Исследование оптических** характеристик

Рассмотрим полупроводниковую пластину SiC политипа 6H с луночным микрорельефом, находящуюся в воздухе при температуре T, представляющую собой излучающую цилиндрическую полость. Поскольку монокристаллический карбид кремния является широкозонным полупроводником, он частично прозрачен в видимом диапазоне, край его поглощения лежит в фиолетовой области спектра. Поэтому задача теплового переноса рассматривается как трехмерная задача, энергия E излучается не только с поверхностей кристалла, но и с внутренней части (рис 2). Ослабление проходящего через кристалл излучения в основном обусловлено поглощением и рассеянием на дефектах структуры и примесях.

Настоящая методика расчета коэффициента излучения Si-пирометрической микросистемы с луночным микрорельефом базируется на наиболее общих теоретических зависимостях по тепловому излучению частично прозрачных тел, описанных теорией Мак Магона [14].



**Рис. 2.** Оптико-геометрическая модель пластины SiC с луночным микрорельефом.

Особенностью предложенного метода является использование значений высоких температур.

Закон сохранения состояния термодинамического равновесия для полупрозрачных тел описывается уравнением:

$$\varepsilon^*(\lambda, T) + \rho^*(\lambda, T) + \tau^*(\lambda, T) = 1, \tag{1}$$

где  $\varepsilon^*(\lambda,T)$  — кажущийся коэффициент излучения,  $\rho^*(\lambda,T)$  — кажущийся коэффициент отражения,  $\tau^*(\lambda,T)$  — кажущийся коэффициент пропускания. В формуле (1) учтены обе независимые поляризации света. Поляризационные свойства определяются коэффициентами излучения для s-поляризованного и p-поляризованного излучений:

$$\varepsilon^*(\lambda, T) = \frac{\varepsilon_p^*(\lambda, T) + \varepsilon_s^*(\lambda, T)}{2}.$$
 (2)

Вследствие многократных внутренних отражений, которые увеличивают значение коэффициента отражения, кажущийся коэффициент отражения  $\rho^*(\lambda,T)$  всегда больше, чем нормальный коэффициент отражения  $\rho(\lambda,T)$ .

Теория Мак Магона применима для нормального падения ( $\alpha=0^\circ$ ) излучения на поверхность изотропных тел, поэтому здесь будут внесены некоторые поправки, в которых будет учтена анизотропия кристаллов карбида кремния.

Базовая плоскость 6H—SiC(0001) перпендикулярна оптической оси кристалла, поэтому коэффициент отражения анизотропного материала для нормального падения [15]

$$\rho_a(\lambda, T) = \frac{(n(\lambda, T) - 1)^2}{(n(\lambda, T) + 1)^2}.$$
(3)

Относительный показатель преломления определяется  $n(\lambda,T)=n_1(\lambda,T)/n_2(\lambda,T)$ , где  $n_1(\lambda,T)$  — показатель преломления в (среде) воздухе,  $n_2(\lambda,T)$  — показатель преломления обыкновенного луча в SiC.

Поверхность, полученная при электроэрозионной обработке монокристалла карбида кремния, содержит микронеровности, в виде лунок различной формы, нерегулярно расположенных по обработанной поверхности. Максимальная высота неровностей профиля составила  $R=1.17-3.06\,\mu\mathrm{m}$ . Такие неровности превышают длину волны светы и вызывают рассеяние. Это приводит к уменьшению зеркального отражения

$$\rho_z(\lambda, T) = \rho_a(\lambda, T) \exp\left(-\left[\frac{4\pi\sigma n(\lambda, T)}{\lambda}\right]^2\right), \quad (4)$$

где  $\sigma$  — среднеквадратичное отклонение точек поверхности от среднего значения.

Диффузионное отражение можно найти

$$\rho_d(\lambda, T) = \rho_a(\lambda, T) \left[ \frac{4\pi\sigma n(\lambda, T)}{\lambda} \right]^2.$$
 (5)

Полный коэффициент отражения

$$\rho(\lambda, T) = \rho_z(\lambda, T) + \rho_d(\lambda, T). \tag{6}$$

Коэффициент пропускания с учетом поглощения внутри кристалла равен

$$\tau(\lambda, T) = \exp(-k(\lambda, T)d), \tag{7}$$

где d — толщина пластины,  $k(\lambda,T)$  — коэффициент поглощения кристалла.

Кажущийся коэффициент излучения кристалла для комнатной температуры равен

$$\varepsilon^*(\lambda, T) = (1 - \tau(\lambda, T)) \frac{(1 - \tau(\lambda, T))}{(1 - \rho(\lambda, T)\tau(\lambda, T))}.$$
 (8)

Поскольку необходимых данных о коэффициенте поглощения и показателе преломления SiC 6H при высоких температурах не обнаружено, для перевода коэффициента излучения в область высоких температур воспользуемся зависимостью  $\varepsilon(T)$ , полученной экспериментально [16]. Тогда  $\varepsilon_1^*(\lambda, T_1)$ , при температуре  $T_1$  можно найти

$$\varepsilon_1^*(\lambda, T_1) = \varepsilon^*(\lambda, T) + 0.00011(T_1 - T).$$
 (9)

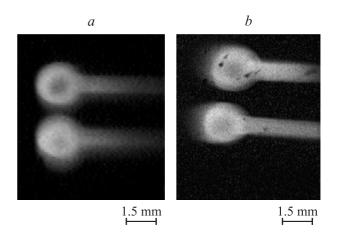
Исследуемая пластина с луночным микрорельефом представляет собой излучающую цилиндрическую полость. Поскольку эффективная интенсивность излучения является суммой собственного и отраженного от стенок полости излучения и зеркальная составляющая отражения не учитывается, так как в направлении нормали к поверхности дна энергия излучения не будет отражаться, эффективный коэффициент излучения дна лунки [17]

$$\varepsilon_e(r) = \varepsilon_1^*(\lambda, T_1) + \rho_d(\lambda, T) \int_0^t \varepsilon_e(x) d\phi_{dx-dr},$$
 (10)

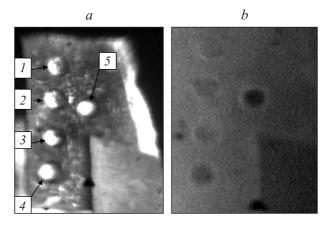
где l=h/R — глубина лунки в безразмерном виде, x=X/R — расстояние от открытого конца цилиндрической полости в безразмерном виде,  $r=r_d/R$  — расстояние от центра дна цилиндра в безразмерном виде,  $d\phi_{dx-dr}$  — элементарный угловой коэффициент от элемента цилиндрической поверхности dx на концевой элемент дна dr, R — радиус полости,  $\varepsilon_e(x)$  — эффективный коэффициент излучения боковой поверхности лунки. Эффективный коэффициент излучения дна лунки находится по методу итераций с использованием ЭВМ.

Исходные данные для расчета: монокристалл 6H—SiC (базовые грани (0001)) толщиной  $D=0.45\,\mathrm{mm}$  с луночным рельефом, концентрация нескомпенсированных доноров  $N_d-N_a=3.4\cdot 10^{18}\,\mathrm{cm}^{-3}$ , нормально излучает при температуре  $1250^{\circ}\mathrm{C}$ . Длина волны излучения  $\lambda=650\,\mathrm{nm}$ . Коэффициент поглощения  $k_s(\lambda,T)=13\,\mathrm{cm}^{-1}$ ,  $k_p(\lambda,T)=26\,\mathrm{cm}^{-1}$  для s- и p-поляризации [18,19]. Радиус цилиндрической лунки  $R=0.5\,\mathrm{mm}$ . Расчеты производились для глубины лунки h=0— $0.4\,\mathrm{mm}$ .

В случае SiC-пирометрических микросистем экспериментальные исследования, при которых зонды помещались в различные области пламени или нагревались в



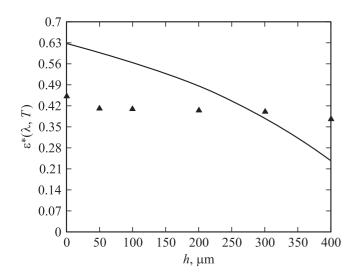
**Рис. 3.** Распределения яркости в SiC-микросистеме. Фото. Эксперимент.  $T=1573~{\rm K}$ : a — вид со стороны лунки, b — вид с обратной (плоской) стороны.



**Рис. 4.** Пластинчатый монокристалл 6H—SiC с лунками (толщина  $450\,\mu\mathrm{m}$ ). Фото. Эксперимент. a — изображение без нагрева, b — изображение при нагреве,  $T=1573\,\mathrm{K}$ ; глубина лунки: I — 50, 2 — 100, 3 — 200, 4 — 300, 5 —  $400\,\mu\mathrm{m}$ .

воздушной среде муфельной печи, показали, что поверхность с лункой также обладает неравномерной яркостью свечения, однако, как следует из рис 3, распределение яркости носит аномальный характер. Достаточно хорошо видно, что яркость поверхности SiC как на дне лунки, так и с обратной стороны площадки значительно меньше периферийных областей. Такая тенденция сохранялась во всем температурном диапазоне исследований ( $\Delta T = 1000-1300^{\circ}$ C). Количественная оценка коэффициента излучения пирометрической микросистемы показала, что в области лунки его численное значение составило  $\sim 0.403$ , а в периферийной области —  $\sim 0.450$  при температуре  $T = 1300^{\circ}$ C.

Для изучения вопроса, связанного с коэффициентом излучения поверхности SiC в лунке, были проведены дополнительные эксперименты. В частности, для оценки влияния глубины лунки на коэффициент излучения



**Рис. 5.** Зависимость коэффициента излучения поверхности кристалла 6H—SiC от глубины лунки.  $N_d$ — $N_a$  =  $3.4 \cdot 10^{18}$  cm<sup>-3</sup>,  $T = 1250^{\circ}$ C. Расчет — сплошная линия. Эксперимент — треугольники.

в пластинчатом монокристалле 6H—SiC (базовые грани (0001)) с помощью методов электроэрозионной технологии и последующего химического травления были изготовлены лунки диаметром 1 mm различной глубины (рис. 4). Исследуемые кристаллы SiC и платиновый излучатель помещались в муфельную печь. Учитывая, что исследуемые образцы обладали небольшими размерами, в условиях свободной конвекции в объеме печи их температурное поле можно было считать равномерным [6].

На рис 5 приведены экспериментальная и теоретическая зависимости монохроматического коэффициента излучения кристалла SiC от глубины лунки.

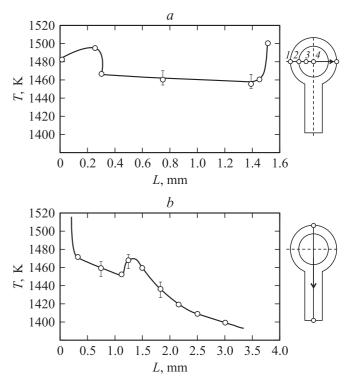
Отличие экспериментальных данных от теоретических может быть объяснено тем, что для перевода коэффициента излучения в область высоких температур использовалась линейная аппроксимация зависимости  $\varepsilon_{\lambda} = f(T)$  [16], однако, это может вносить погрешность в расчет, поскольку известная зависимость имеет маленькую крутизну. Используемые при расчете данные коэффициента поглощения, показателя преломления могут отличаться для исследуемых образцов за счет различия условий экспериментальных исследований.

# Результаты исследований теплофизических и гидродинамических характеристик

Определенный научный и практический интерес представляют также знания о температурных полях пирометрической микросистемы с луночным рельефом в

экстремальных условиях эксплуатации. Это связано не только с апробацией методики различных измерений, но и с необходимостью оптимизации конструкций микросистем. Экспериментальные исследования проводились в диапазоне температур  $T = 1000 - 1350^{\circ}$ С при фиксированных значениях скорости газового потока. Была реализована методика измерений, при которой микросистема помещалась в пламя газовой горелки (область факела), а для получения распределения яркостных температур в пределах поверхности микросистемы использовалась программа "Парус". Переход к действительным температурам осуществлялся по соотношению, известному из теории пирометрии [13], и с учетом изменения (уменьшение) коэффициента излучения SiC в пределах лунки согласно экспериментальной зависимости на рис. 5.

Приведенные на рис. 6 графики показывают, что распределение температур по выделенным направлениям в пределах поверхности системы носит неоднородный характер. Несмотря на то что температура в центре лунки отличается от температуры периферийных участков зонда на  $2\sim2.5\%$ , поверхность лунки можно считать изотермической. Детальный анализ показал, что неравномерность температурного поля в качественно изготовленной лунке оказывается менее 1%. Такой характер распределения температур обусловлен особенностями процесса теплопередачи в тонких слоях материала [6].



**Рис. 6.** Распределение температур по выделенным направлениям SiC-микросистемы. Эксперимент. Продольный обдув, газовое пламя: пропан, V=3.2 m/s,  $T_n=1523$  K. a — поперечный контур, b — продольный контур.

#### Заключение

Подводя итоги, отметим, что фактически дно лунки пирометрической микросистемы следует рассматривать как мембранную структуру. Малая толщина SiC-мембраны в условиях высоких температур способствует появлению незначительных градиентов температуры по толщине и существенно усиливает роль поверхностного теплообмена, в результате которого происходит равномерный нагрев. В результате экспериментальных исследований было получено значение коэффициента излучения SiC-микросистемы в условии высокой температуры  $T=1300^{\circ}\mathrm{C}$ , которое составило в области лунки  $\sim 0.403$ , а в периферийной области  $\sim 0.450$ .

## Список литературы

- [1] *Самсонов Г.В., Виницкий И.М.* Тугоплавкие соединения. М.: Металлургия, 1976. 560 с.
- [2] *Лучинин В.В., Таиров Ю.М.* // Петербургский журн. электроники. 1996. № 2 (11). С. 53–78.
- [3] *Карачинов В.А., Ильин С.В., Карачинов Д.В.* // Письма в ЖТФ. 2005. Т. 31. Вып. 11. С. 1–4.
- [4] Иванов П.А., Левинитейн М.Е., Мнацаканов Т.Т. и др. // ФТП. 2005. Т. 39. Вып. 8. С. 897–913.
- [5] Водаков Ю.А., Круглов Е.М., Мохов Е.Н. и др. // Сб. докл. III Междунар. семинара "Карбид кремния и родственные материалы". Великий Новгород, 2000. С. 206–212.
- [6] Лыков А.В. Тепломассообмен. М.: Энергия, 1978. 480 с.
- [7] *Михеев М.А., Михеева И. М.* Основы теплопередачи. М.: Энергия, 1973. 320 с.
- [8] Быстров Ю.А., Исаев С.А., Кудрявцев Н.А., Леонтьев А.И. Численное моделирование вихревой интенсификации теплообмена в пакетах труб. СПб.: Судостроение, 2005. 392 с.
- [9] *Кутателадзе С.С., Леонтьев А.И.* Тепломассообмен и трение в турбулентном пограничном слое. М.: Энергия, 1972. 342 с.
- [10] *Маслов В.П., Данилов В.Г., Волосов К.А.* Математическое моделирование процессов тепломассопереноса. М.: Наука, 1987. 352 с.
- [11] Карачинов В.А. Способ эрозионного копирования карбидокремниевых структур. // Пат. России. № 2 189 664. 2002.
- [12] *Карачинов В.А., Торицин С.Б., Карачинов Д.В.* // Измерительная техника. 2008. № 7. С. 42–47.
- [13] Свет Д.Я. Оптические методы измерения истинных температур. М.: Наука, 1982. 296 с.
- [14] Mc.Mahon H.O. // J. Opt. Soc. Amer. 1950.Vol. 40. P. 376.
- [15] Кизель В.А. Отражение света. М.: Наука, 1973. 352 с.
- [16] *Карачинов Д.В., Карачинов В.А.* Пирометрические зонды на основе тугоплавких соединений. Великий Новгород: НовГУ, 2008. 123 с.
- [17] Излучательные свойства твердых материалов. Справочник. / Под ред. А.И. Шейндлина. М.: Энергия, 1974. 671 с.
- [18] *Таиров Ю.М., Цветков В.Ф.* Справочник по электротехническим материалам / Под ред. Корицкого Ю.В, Пасынкова В.В., Тареева Б.М. Л.: Энергоатомиздат, 1988. С. 446–472.
- [19] Dubrovskii G.B., Lepneva A.A, Radovanova E.I. // Phys. Stat. Solid. B. 1973. Vol. 57. N 1. P. 423–431.